Short Report

高濃度カーボンナノチューブ複合ポリイミド薄膜の機械的特性評価

藤井達也¹, 大金健太², 鈴木庸久¹

1 秋田県立大学システム科学技術学部機械工学科

2 元 秋田県立大学大学院システム科学技術研究科機械知能システム学専攻(現 セイコーエプソン(株))

近年,部品内蔵フレキシブル基板用の湿度モニタリング技術が提案されている.本研究では,高信頼性を有する湿度センサの素材開 発を行うため,ポリイミド (PI)の前駆体であるポリアミック酸 (PAA)をカーボンナノチューブ (CNT)に被覆した PAA 被覆 CNT 粒子の製造技術を援用して高濃度 CNT 複合 PI 薄膜を作製し,その機械的特性を評価した.具体的には,PAA 被覆 CNT 粒子を溶媒 中に分散した PAA/CNT 分散液を作製し,スピンコート法で成膜した後に溶媒を揮発させることで薄膜化し,高濃度 CNT 複合 PI 薄 膜を作製した.さらに,CNT 複合 PI 薄膜の引張試験を行い,機械的特性と CNT 濃度との関係を評価した.引張試験の結果,CNT 濃度が 0~20 wt%の試験片において延性領域を維持する結果となった.これは,本研究で作製した CNT 複合 PI 薄膜が良分散状態で あることを示唆している.CNT 濃度の増加とともにヤング率が向上した一方,0.2%耐力は減少した.これらの結果は,強化材料で ある CNT と母材である PI 間のマトリックス界面の密着性に起因するものと考えられる.

キーワード:カーボンナノチューブ,ポリイミド,複合材料,スピンコート,薄膜,機械的特性

電子機器の小型軽量化,高性能化,高信頼化を推 進する有力な実装技術として,プリント配線板内部 に電子部品(受動部品,能動部品,モジュール,MEMS 等)を埋め込み実装する部品内蔵基板が注目されて いる.部品内蔵基板をフレキシブルデバイスに適用 する場合,繰り返しの引張・曲げ・ねじり変形によ りフレキシブル配線板の接着層が剥離し,内蔵部品 が動作不良を起こすリスクが高い.すなわち,部品 内蔵フレキシブル基板の寿命や安定性は実装技術の 信頼性に大きく依存される.

実装された電子部品の健全性を監視し、パッケージの破損を早期に発見することを目的として、高分子感湿材料を用いた湿度センサによるパッケージ内部の湿度モニタリング技術が提案され、これまでに吸湿性のポリイミド(PI)薄膜を用いた湿度センサが開発されている.しかし、PI薄膜を用いた抵抗型湿度センサは、湿度変化とともに電気抵抗が指数関数的に変化するため、相対湿度30%以下において湿

度検出ができない. PI 薄膜にカーボンナノチューブ (CNT)を複合化することで,薄膜の抵抗が低下し, 線形性が向上する研究例が報告されているものの, CNT は凝集性が非常に強く,樹脂中へのナノスケー ル分散は困難であり,高濃度の CNT を複合化した PI 薄膜を製造することは技術的ハードルが高い.

本研究室では、レジンボンド砥石の強度、耐熱性 等を改善した高性能砥石を開発するため、PI 樹脂中 へ高濃度かつ良分散状態の CNT を均一分散する技 術を確立した(鈴木ら, 2019, 佐々木ら, 2020).こ の技術は PI の前駆体であるポリアミック酸(PAA) を CNT に被覆した PAA 被覆 CNT 粒子を用い、反応 成形法によって砥石を作製する技術である.本稿で は、PAA 被覆 CNT 粒子の製造技術を援用して超高 濃度の CNT 複合 PI 薄膜を作製し、独自開発した薄 膜引張試験装置を用いて機械的特性を評価した.

責任著者連絡先:藤井達也 〒015-0055 由利本荘市土谷字海老ノロ 84-4 公立大学法人秋田県立大学システム科学技術学部機械工 学科. E-mail: t-fujii@akita-pu.ac.jp

薄膜引張試験装置

図1に,既存の薄膜引張試験装置の概略を示す. この装置は,駆動部,変位・荷重測定部,および試 験片把持部から構成され,駆動部には PI 製 PZT ア クチュエータ P-845.20V,変位測定部には新光電機 製差動変位計(LVDT)1500-9KV,荷重測定部には テック技販製微小荷重ロードセル TGRV08-2NB を 用いている.なお,試験片把持部には安定した固定 が可能なメカニカルチャック方式を採用している

(Namazu et al., 2011). 試験装置は PZT アクチュエ ータの性能を最大限に発揮するため,変位増幅機構 を有するアクチュエータケースを設けている. この 機構の形状寸法を最適化することにより,一方向に 伸張するアクチュエータの駆動軸と発生力を変更・ 分割し,試験片把持部の双方向駆動を実現している.



図1 薄膜引張試験装置

図2に、引張試験システムの構成を示す.PC内の DAボードからPZTアンプを介してPZTアクチュエ ータに電圧を印加することにより、試験片の軸方向 に引張ストロークを発生させる.引張変位と荷重は、 LVDT ならびにロードセルアンプからの出力電圧を PC内のADボードで取得することにより測定する. 今回は、試験片平行部のみの変位を直接測定するため、画像計測による標点位置計測システムを新たに 開発した(土屋と船橋,2003, Freeman et al., 1998). 薄膜試験片のポアソン比測定においては、試験片長 手方向の変位に加えて、幅方向または厚み方向の微 小変位を計測する必要がある.本研究では、図3に 示すように引張試験中の試験片画像を CCD カメラ で取得し、画像処理によって試験片上の標点変位を 計測する.試験片平行部の4カ所にゲージマークを 設けることにより、試験片の縦ひずみと横ひずみを 同時に計測し、計測されたひずみからヤング率とポ アソン比を定量評価する.



図2 引張試験システム



図3 標点位置計測方法

高濃度 CNT 複合 PI 薄膜の機械的特性評価

複合薄膜の作製

図4に、PAA 被覆 CNT 粒子作製の概略を示す. 再沈殿法は、界面活性剤等の分散剤を使用せず、目 的とする有機材料を良溶媒に溶かした溶液を貧溶媒 に滴下して粒子を作製する方法である.本研究では、 表1に示す原材料を PAA に対する CNT の割合が 30 wt%となるように混合し、hielscher 製超音波ホモジ ナイザ UP400S を用いて出力 70%、処理時間 1 min 攪拌することで混合溶液を作製した. 混合溶液を貧 溶媒である IPA 中へ滴下し、溶媒である NMP を除 去した後,吸引濾過と常温乾燥させることにより PAA 被覆 CNT 粒子を得た.



Particulation of mixed varnish by reprecipitation technique

PAA coated CNT particles

図4 PAA 被覆 CNT 粒子の作製

表1 PAA 被覆 CNT 粒子の原材料

PAA/NMP	U-Varnish-A,
solution	Ube Industries, Ltd.
CNT/NMP	ORGACYL [™] NMP0502,
dispersions	Nanocyl
Solvent	NMP,
	Kishida Chemical Co.,Ltd.

図 5 に、PAA/CNT 分散液の作製と薄膜化の概略 を示す.ふるいを用いて 53 μ m 以下の PAA 被覆 CNT 粒子を選定した. PAA/NMP 溶液に PAA に対する CNT の質量比が 0, 5, 10, 20 wt%となるように混 合し, hielscher 製超音波ホモジナイザ UP200St を用 いて出力 70%,処理時間 24 min 攪拌することで PAA/CNT 分散液を作製した. その後,スピンコー ト法にて PAA/CNT 分散液を塗布し,温度を段階的 に上昇(最大 350 °C, 10 min) させ,溶媒を揮発さ せることにより薄膜化した.





薄膜引張試験片の作製

図6に, CNT 複合 PI 薄膜引張試験片の作製工程 を示す.試験片は DRIE 加工等の半導体加工技術を 用いて作製した.試験片作製のための供試材料には, 300 nm 厚さの SiO₂層を有する Si ウェハを用いた. 本研究では, CNT 複合 PI 薄膜と Si ウェハをの密着 性を向上させるため, Si ウェハ上に信越化学工業製 シランカップリング剤 KBE-903 を塗布した後, CNT/PI 複合薄膜を成膜した.試験片は評価対象の 薄膜材料と支持基板との積層構造であり,評価部の 薄膜のみが自立している.薄膜試験片部は2つのチ ャック穴の中央に配置されており,この穴に薄膜引 張試験装置の試験片把持部にある突起を引っ掛けて 薄膜部に引張負荷を与える.



図 6 CNT 複合 PI 薄膜引張試験片の作製工程と 作製結果

機械的特性評価と考察

本研究では、画像計測システムを付加した薄膜引 張試験装置を用いて、チャック間距離 6.5 mm、引張 速度 0.5 µm/s、初期荷重 0 N で引張試験を実施した. 予備実験として、スピンコートにより作製した PI 薄膜における機械的特性の異方性を評価するため、 ウェハ面内から 2 カ所の引張試験片(試験片平行部 がウェハ半径方向に対して平行、垂直)を選択し、 引張試験を実施した.図7に、引張試験により得ら れた PI 薄膜(平行方向)の応力-ひずみ線図の一例 を示す.図中の黒プロットは、CCD カメラを用いた 画像計測から求めた試験片平行部の縦ひずみと引張 応力との関係を表している. 画像計測により求めた PI 薄膜のヤング率は 3.6 GPa であり, 白プロットで 示す横ひずみと黒プロットの縦ひずみから算出した PI 薄膜のポアソン比は0.29 であった. これらの値は, PI 薄膜の文献値と良く一致しており,本研究で開発 した引張試験技術は, 薄膜材料の機械的特性評価に 有効であると言える (So, Cho, & Sahoo, 2007). なお, PI 薄膜 (垂直方向)のヤング率とポアソン比はそれ ぞれ 3.7 GPa, 0.30 となり, ウェハ面内における PI 薄膜の機械的特性は均一と考えられる.



図7 PI 薄膜(平行方向)の応カーひずみ線図

図8に,50 µm 幅の4 種類の CNT 複合 PI 薄膜試 験片(0~20 wt%)の応力-ひずみ線図の代表例を 示す.本研究では、大気中、常温下で試験装置の最 大引張変位に至るまで引張負荷を付与した.4 種類 の試験片は CNT 濃度に関係なくすべて延性領域を 維持する結果となった. これは、PI 薄膜中の CNT が良分散状態であることを示唆している. 図9に, CNT 濃度とヤング率との関係を示す. ヤング率は, 応力-ひずみ線図で得られたひずみの0.05~0.5%の 範囲を弾性域として算出した. 0~20 wt%の平均ヤ ング率はそれぞれ、3.7、3.9、4.0、4.2 GPa であり、 CNT 濃度の増加とともにヤング率が向上している ことがわかる.本研究では、母材である PI 薄膜に対 して最大 1.13 倍のヤング率を得た. 図 10 に, CNT 濃度と 0.2%耐力との関係を示す. 0~20 wt%の 0.2% 耐力の平均値はそれぞれ, 86.6, 64.7, 61.0, 41.8 MPa であり、CNT 濃度の増加とともに 0.2%耐力が減少 していることがわかる. これは, CNT 濃度の増加と

ともに,強化材料である CNT と母材である PI 間の マトリックス界面で剥離が生じやすくなり,試験片 強度が低下したことが挙げられる.さらに,CNT 濃 度の増加に伴い,試験片表面の表面粗さが粗くなっ ており,降伏点の低下に影響を及ぼしていると考え られる.



図8 CNT 複合 PI 薄膜の応カーひずみ線図



図9 CNT 濃度とヤング率との関係



図 10 CNT 濃度と 0.2% 耐力との関係

結言

本研究では、PAA を CNT に被覆した PAA 被覆 CNT 粒子の製造技術を援用して、高濃度 CNT 複合 PI 薄膜を作製した. CNT 複合 PI 薄膜を評価部とす る試験片を作製して引張試験を行った結果、CNT 濃 度が 0~20 wt%の試験片において延性領域を維持す る結果となった. これは、本研究で作製した CNT 複合 PI 薄膜が良分散状態であることを示唆してい る. CNT 濃度の増加とともにヤング率が向上した一 方、0.2%耐力は減少した. これらの結果は、強化材 料である CNT と母材である PI 間のマトリックス界 面の密着性に起因するものと考えられる.

文献

- 佐々木正太, 鈴木庸久, 藤井達也, 野村光由 (2020). 「高濃度カーボンナノチューブ複合ポリイミド 樹脂を用いたレジンボンド砥石の機械的特性」 『砥粒加工学会学術講演会論文集』D23.
- 土屋智由,船橋博文(2003).「薄膜引張試験による 多結晶シリコン膜のヤング率測定」『電気学会論 文誌 E (センサ・マイクロマシン部門誌)』123 (12),577-582.
- 鈴木庸久,泉妻孝迪,大津加慎教(2019). 「樹脂 被覆カーボンナノチューブ」特開 2019-178027.

- Freeman, D. M., Aranyosi, A. J., Gordon, M. J., & Hong, S. S. (1988). Multidimensional Motion Analysis of MEMS using Computer Microvision. *Technical Digest of Solid-State Sensors and Actuators Workshop*, 150-155 (8 pages).
- Namazu, T., Nagai, Y., Naka, N., Araki, N., & Inoue, S. (2011). Design and development of a biaxial tensile test device for a thin film specimen. *Journal of Engineering Materials and Technology*, 134(1), 011009 (8 pages).
- So, H. H., Cho, J. W., & Sahoo, N. G. (2007). Effect of carbon nanotubes on mechanical and electrical properties of polyimide/carbon nanotubes nanocomposites. *European Polymer Journal*, 43(9), 3750-3756.

 令和 3 年 7 月 30 日受付 令和 3 年 9 月 1 日受理

Mechanical Characterization of High-Concentration Carbon Nanotube/Polyimide Composite Thin Films

Tatsuya Fujii¹, Kenta Ogane², Tsunehisa Suzuki¹

¹ Department of Mechanical Engineering, Faculty of Systems Science and Technology, Akita Prefectural University ² Former student of Course of Machine Intelligence and Systems Engineering, Graduate School of Systems Science and Technology, Akita Prefectural University (Presently at Seiko Epson Corporation)

Recently, using a humidity monitoring technique was proposed for flexible substrates with built-in components. In this study, high-concentration carbon nanotube/polyimide (CNT/PI) composite thin films were prepared using the fabrication technique of PI precursor polyamic acid (PAA)-coated CNT particles, and their mechanical properties were evaluated to develop materials for highly reliable humidity sensors. To manufacture ultrahigh-concentration CNT/PI composite thin films, PAA/CNT dispersions in which PAA-coated CNT particles were dispersed in a solvent were prepared through a spin-coating procedure and then the solvent was volatilized. Tensile tests were also performed on the 0–20 wt% CNT/PI composite thin films to determine the link between the mechanical properties and amount of CNT applied. Tensile testing revealed that the ductile zone of the material with a CNT content of 0 to 20 wt% was preserved. This indicates that the CNT composite PI thin film created in this study is well distributed.

Keywords: Carbon nanotube, Polyimide, Composite material, Spin coating, Thin film, Mechanical property

Correspondence to: Tatsuya Fujii, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Systems Science and Technology, Akita Prefectural University, 84-4 Aza Ebinokuchi, Tsuchiya, Yurihonjyo, Akita 015-0055, Japan. E-mail: t-fujii@akita-pu.ac.jp